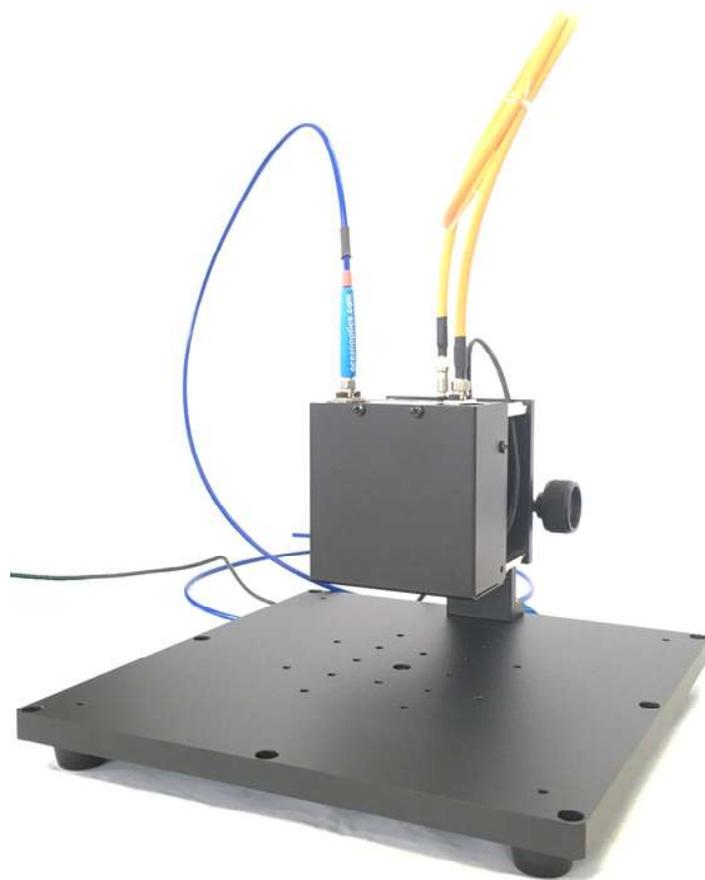


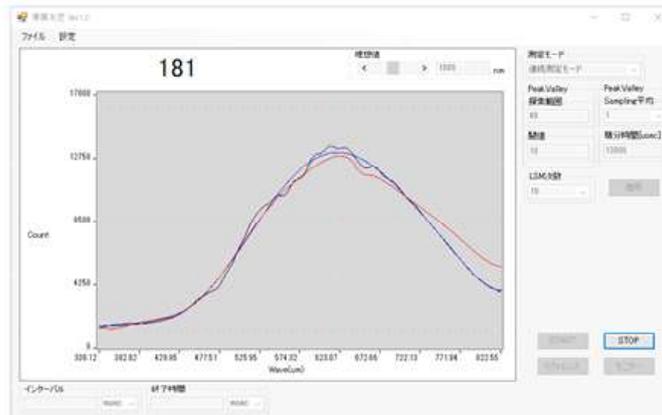
HE3224  
光干渉膜厚計



シリコンウエハなど透明の薄膜を光の干渉を利用して高精度に測定します。



測定画面（開発中のもの）



< 仕 様 >

測定範囲	:	100nm~2000nm
測定層数	:	単層
測定方法	:	可視分光方
精度	:	1nm
誤差	:	0.5nm
使用電源	:	5V(USB)
参考値	:	494.14nm(494.19nmサンプル測定) 82.21nm(82.24nmサンプル測定)

< 内 容 >

測定ヘッド	1台
測定台	1台
分光器	1台
分光器~ヘッド間光ファイバー	1本
USBケーブル	1本(1m)
制御ソフト(Windows7以上)	
※ 本製品には制御PCは付属していません	

< オ プ シ ョ ン >

光源(タングステンハロゲン20W以上)  
光源~ヘッド間光ファイバー(1m)

お断りなく仕様を変更する場合がございますのでご了承ください

株式会社 豊伸電子  
〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平3-9-12  
TEL 044-861-0202(代) FAX 044-861-0121  
E-mail: info@hoshin-el.co.jp